

2017年11月24日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
東証第1部コード6920
代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 経営企画室 室長 浅井 浩志

新製品 第10.5世代用「FPDフォトマスク欠陥検査装置 CLIOS G10シリーズ」および「CLIOS用ペリクル検査/貼り付けシステム 71PA CM」を発表

この度レーザーテック株式会社は、第10.5世代用のFPDフォトマスク欠陥検査装置 CLIOS G10シリーズ、およびペリクル検査/貼り付けシステム 71PA CMの2製品を発表致します。CLIOS G10シリーズは、FPDの生産に使用される第10.5世代大型フォトマスクの高感度かつ高スループットな欠陥検査が可能です。71PA CMは第10.5世代までの様々なサイズのペリクルの貼り付け作業を、マスク欠陥検査直後のクリーンな環境下において、リモート操作で実施することが可能です。

近年の FPD 業界では、スマートフォンやタブレット端末に代表される中小型高精細ディスプレイ、4K・8K 高解像度大型テレビ等への対応が急務となっており、フォトマスクのパターンの微細化および基板サイズの大規模化が急速に進展しています。また、中国における10.5世代液晶ディスプレイ工場、韓国における有機ELディスプレイ工場への投資が相次いでいることから、FPD用大型フォトマスク検査の必要性が更に高まっております。

レーザーテックでは、こうした市場のニーズに対応すべく、第10.5世代に対応したFPDフォトマスク欠陥検査装置、およびペリクル検査/貼り付けシステムを製品化する事により、高品質フォトマスクの開発及び生産に貢献致します。

【特長】

CLIOS G1001

- 第10.5世代(2000mm×1800mm)までのフォトマスク欠陥検査及び欠陥レビューが可能
- 高機能欠陥検出アルゴリズムとデータベースの高解像化による高感度化を実現
- Die to DieとDie to Databaseの同時検査(コンボモード)が可能
- 新設計ステージと高速化した欠陥検出処理ユニットにより、検査時間を短縮(従来比3割削減)
- SECS/GEMによるフルオートメーション処理が可能

71PA CM

- 第10.5世代までの様々なサイズのペリクルに対応
- マスクへのペリクル貼り付けをマスク検査直後にリモートで実施でき、異物付着リスクを最小化
- 異物検査機能により、ペリクル表面、裏面の異物検査が可能(オプション)

【用途】

- FPD用大型フォトマスク及びペリクルの受入検査および定期的な品質検査
- FPD用大型 フォトマスク及びペリクルの出荷前品質検査



CLIOS G1001+71PA CM

【仕様:CLIOS G1001】

項目	仕様
検出感度	0.4 μ m ※感度チェック用マスクで保証
検査時間	8時間 (1760mm×1600mm)
検査可能マスクサイズ	800mm (W)×520mm (H) ~ 2000mm (W)×1800mm (H)
検査可能マスク	ハーフトーンマスク、グレートーンマスク、バイナリーマスク

【仕様:71PA CM】

項目	仕様
検出感度	5 μ m
検査時間	35分 (10.5G用ペリクル)
対応可能なペリクルサイズ	10.5Gまでのペリクルサイズにマルチ対応

◇製品お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第3ソリューションセールス部 樋口 剛史

TEL:045-478-7337 FAX:045-478-7333 E-mail: sales@lasertec.co.jp

以上